Abstract of the Disclosure:

電着法、熱CVD法またはスプレー法により被膜7を形成した後、この被膜にレーザを 照射する。このレーザ照射により、被膜7を構成するカーボンナノチューブが切断され、 カーボンナノチューブの密度が最適化される。このように被膜7を形成することにより、 カソード構体5から安定したエミッションを得ることができる。